

סקר מקדים מס' 383

מספר תיק: 1224801 מפעל: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קמפוס מרכוס
 כתובת: באר שבע, שד' בן גוריון טלפון: 050-6264221 איש קשר: שחר גולדברג - מנהל מחלקת בטיחות,
 חנה בן גלים

איפיון של מטלות ותהליכים

MSDS	תדירות שימוש	חומר
שם המרכיב	אחוז מרכיב	גורם חשיפה
מחלקה: ננו-טכנולוגיה מבוססת DNA / קמפוס מרכוס / בניין SMB 29 / חדר 105		
מטלה: אינטרקציה חילבון DNA		מספר עובדים: 5

תהליך:	הרצה- ג'יל
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף

מרכיבים בתהליך:	ETHIDIUM BROMIDE	חודשית	V	V
	ETHIDIUM BROMIDE			

תהליך:	שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף

מרכיבים בתהליך:	אצטון	יומית	V
	אצטון		
	אתנול	יומית	V
	אתנול		

תהליך:	תהליכי עזר - איחסון		
איפיון תהליך:	כמות חומר בשימוש: מועטה		
מרכיבים בתהליך:	חומצה הידרופלואורית	נדיר	V
	איזופורון		

תהליך:	הרדמה- מתבצעה בחדר 005	
איפיון תהליך:	שיטה: ממוכן בהפעלה צמודה של עובד, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
מרכיבים בתהליך:	איזופלורן	V
	איזובוטיל אלכוהול	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה
אחוז מרכיב	חומר
מחלקה: מעבדה כימית רטובה / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 119	
מטלה: מחקר אופטואלקטרוניקה מולקולרית	
מספר עובדים: 7	

	תהליך:	שטיפה/ניקוי
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	מנדף אוורור כללי

V	יומית	IPa
		איזופרופיל אלכוהול
V	יומית	אצטון
		אצטון
V	יומית	מתנול
		מתנול

	תהליך:	שטיפה/ניקוי- ניקוי לינזות
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אוורור כללי מנדף

V	נדיר	חומצה גופרתית
		חומצה גופרתית

	תהליך:	בדיקות כימיות-ללא מכשור- ספינינג
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
	ציוד מגן אישי:	נשמית כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אוורור כללי מנדף

V	שבועית	כלורובנן
		כלורובנן

	תהליך:	בדיקות כימיות-ללא מכשור- טבילה
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	מנדף אוורור כללי

V	שבועית	דיכלורואתן
		דיכלורואתן (1,2)
V	שבועית	כלורופורם
		דיכלורואתן (1,2)

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
MSDS	כמות חומר זעירה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
גורם חשיפה	חומר
מחלקה: ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 305	
מטלה: מחקר לכימיה אורגנית	מספר עובדים: 15

תהליך:	תהליכי יצור כימים / (ריאקטור) - סינטז חילבונים
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	מתילן כלוריד מתילן כלוריד
V	יומית

תהליך:	בדיקות כימיות-ללא מכשור - פפטידים קצרים
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	חומצה אמינית
V	יומית
V	AMINOACID, Ca-salt
V	פלדיום
V	פלדיום

תהליך:	בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: בינונית
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי
מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל אצטוניטריל
V	יומית

מחלקה: ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 306	
מטלה: פפטידים	מספר עובדים: 15

תהליך:	בדיקות כימיות ממוכשרות-אחרות- אוויטורטור
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	מנדף
מרכיבים בתהליך:	חומצה אמינית
V	3-4 פעמים בשבוע
V	AMINOACID, Ca-salt

תהליך:	שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	DMF די - מתיל פורמאמיד
V	יומית
V	אתיל אצטט
V	אתיל אצטט

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה	אחוז מרכיב	
תהליך: בדיקות כימיות-ללא מכשור			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית			
בקרת תהליך: מנדף			
מרכיבים בתהליך:	DMF	יומית	V V
די - מתיל פורמאמיד			

מחלקה: ביורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 107	מטלה: מחקר פפטידים
מספר עובדים: 4	

תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשות-HPLC			
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: בינונית			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית			
בקרת תהליך: אוורור כללי			
מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל	יומית	V
אצטוניטריל			
V V	הקסן	שבועית	
הקסן-נורמלי			

תהליך: בדיקות כימיות-ללא מכשור- סינטזה			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית			
בקרת תהליך: אוורור כללי			
מרכיבים בתהליך:	DMF	יומית	V V
די - מתיל פורמאמיד			

תהליך: שטיפה/ניקוי			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית			
בקרת תהליך: אוורור כללי			
מרכיבים בתהליך:	DSM	יומית	V V
מתילן כלוריד			

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה לכימיה אורגנית ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 212	
מטלה: הוראה	מספר עובדים: 2

תהליך:	עבודות מחקר ופיתוח-אחר- עבודה בצוותים A-D
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: בינונית, קיימת חשיפה עורית
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורר כללי מנדף

מרכיבים בתהליך:	הקסן, פטרול אתר, אתיל אצטט
	מתילן כלוריד
	אתיל אצטט
	פטרול אתר
	הקסן-נורמלי
V	V
	אתנול
	אתנול
	חומצה אצטית
V	חומצה אצטית
	חומצה גופרתית
V	חומצה גופרתית
	חומצה הידרוכלורית
	חומצה הידרוכלורית
	חומצה זרחתית
V	חומצה זרחתית
	טולואן
V	V
	טולואן
	מתילן כלוריד
V	V
	מתילן כלוריד
	ניטרובנזן
V	V
	ניטרובנזן
	פורמאלדהיד
V	V
	פורמאלדהיד
	קסילן
V	V
	קסילן

תהליך:	בדיקות כימיות-ללא מכשור- זיקוק(מאדה)
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	מנדף
מרכיבים בתהליך:	אתיל אצטט
V	אתיל אצטט

תהליך:	שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: בינונית
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
בקרת תהליך:	אזורר כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	אצטון
V	אצטון
	אצטון

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש שם המרכיב	חומר גורם חשיפה	כמות חומר זעירה אחוז מרכיב	
בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC			
תהליך:			
שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
איפיון תהליך:			
כפפות להגנה מחומרים			
ציוד מגן אישי:			
אזור כללי			
בקרת תהליך:			
אזור כללי			
מרכיבים בתהליך:			
V	נדיר	אצטוניטריל	אצטוניטריל

מחלקה: מעבדה לכימיה כללית ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בנין 29 / חדר 304	מטלה: הוראה
מספר עובדים: 2	

הכנת תערובת- טרציה			
תהליך:			
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: בינונית, קיימת חשיפה עורית			
איפיון תהליך:			
כפפות להגנה מחומרים			
ציוד מגן אישי:			
נשמית			
בקרת תהליך:			
אזור כללי			
מנדף			
מרכיבים בתהליך:			
V	V	נדיר	חומצה הידרוכלורית
		32.00%	חומצה הידרוכלורית
V	V	שבועית	טולואן
			טולואן
V	V	נדיר	טריכלורובנזן
			טריכלורובנזן
V	V	נדיר	יוד
			יוד
V	מלחים		
		יומית	חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיק

המלצה/סיכום: שימוש בטולואן פעם בשבוע בקמויות קטנות במינדף	
מחלקה: מעבדה לכימיה פיזיקלית ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בנין 29 / חדר 202	
מטלה: הוראה	
מספר עובדים: 2	

בדיקות כימיות-ללא מכשור- ניסויים סטודנטים			
תהליך:			
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
איפיון תהליך:			
כפפות להגנה מחומרים			
ציוד מגן אישי:			
נשמית			
בקרת תהליך:			
אזור כללי			
מנדף			
מרכיבים בתהליך:			
V	V	חודשית	IPA
			איזופרופיל אלכוהול
V	V	חודשית	אבקות מלחים
			חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיק
V	V	חודשית	אצטון
			אצטון
V	V	חודשית	די - כלורואתן
			די - כלורואתן (1,1)
V	V	חודשית	הקסן
			הקסן-נורמלי
V	V	חודשית	כלורובנזן
			כלורובנזן
V	V	חודשית	פרופנול
			פרופנול (1)
V	V	חודשית	ציקלוהקסן
			ציקלוהקסן

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		

	תהליך:	בדיקות כימיות-ללא מכשור- פולרימטריה
V	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
V	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	מנדף
V	מרכיבים בתהליך:	חומצה גופרתית
		דו חודשית
		חומצה גופרתית

	תהליך:	הכנת תערובת
V	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: בינונית
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזור כללי
	מרכיבים בתהליך:	מנדף
V	בופרים	נדיר
		חומצה גופרתית
		חומצה הידרוכלורית
		CHLORIC ACID

	תהליך:	שטיפה/ניקוי
V	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	מרכיבים בתהליך:	אצטון
		אצטון
		יומית

מחלקה: מעבדה לכימיה כללית אורגנית וביואורגנית /קמפוס מרקוס /בניין 29 /חדר 309	מטלה: הוראה
מספר עובדים: 1	

	תהליך:	הכנת תערובת
V	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
V	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזור כללי
	מרכיבים בתהליך:	מנדף
V	מלחים	3-4 פעמים בשבוע
		חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיק
V	חומצה גופרתית	דו חודשית
		40.00%
V	חומצה הידרוכלורית	דו חודשית
		חומצה הידרוכלורית
V	טריכלורובנזן	דו חודשית
		טריכלורובנזן

	תהליך:	שטיפה/ניקוי
V	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	מרכיבים בתהליך:	אצטון
		אצטון
		יומית

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	אחוז מרכיב
גורם חשיפה	שם המרכיב
מחלקה: מעבדה לתהודה מגנטית ביאורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 007-008	
מטלה: שירות	מספר עובדים: 2

			תהליך: שטיפה/ניקוי
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית
			בקרת תהליך: אוורור כללי
V	יומית	אצטון	מרכיבים בתהליך:
V	יומית	אתנול	
		אתנול	

			תהליך: תהליכי תחזוקה
			איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: גדולה, קיימת חשיפה עורית
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: אוורור כללי
V	חודשית	הליום נוזלי	מרכיבים בתהליך:
V	חודשית	חמצן	
		חנקן נוזלי	
		חמצן	

מחלקה: מעבדה לביואלקטרוניקה ובו סנסורים ביאורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 308	
מטלה: מחקר	מספר עובדים: 6

			תהליך: הכנת תערובת- הכנת דוגמאות
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית
			בקרת תהליך: מנדף
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:
V	V	שבועית	אצטוניטריל
			פירנה
			חומצה גופרתית
			מי חמצן

			תהליך: בדיקות כימיות-ללא מכשור- סינטזה פפטידים
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית
			בקרת תהליך: אוורור כללי
			מנדף
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:
V	V	3-4 פעמים בשבוע	DMF
			די - מתיל פורמאמיד
			כלורופורם
			כלורופורם

			תהליך: שטיפה/ניקוי
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: אוורור כללי
V	V	יומית	מרכיבים בתהליך:
			מתנול
			מתנול

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה לזירים לחקר ביאורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 29 / חדר 207	
מספר עובדים: 2	מטלה: מדידות אנליטיות

תהליך:		בדיקות כימיות-ללא מכשור
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	אתנול	חודשית
V	V	V
	דימתיל סולפוקסיד	חודשית
V	V	V
	מתנול	חודשית
V	V	V

תהליך:		בדיקות כימיות-ללא מכשור
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	חומצה גופרתית	נדיר
V	V	V
	טטרה-הידרופורן	נדיר
V	V	V

תהליך:		שטיפה/ניקוי
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזורור כללי
מרכיבים בתהליך:	אצטון	יומית
V	V	V

מחלקה: מעבדה למיקרואלקטרוניקה ביאורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 33 / חדר 419	
מספר עובדים: 3	מטלה: מיקרואלקטרוניקה ביאורגנית

תהליך:		הכנת תערובת- הכנת התקנים אורגנים
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים נשמית
	בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:	סיבי זכוכית	שבועית
V	V	V
	סיליקון	שבועית
V	V	V
	קוורץ	שבועית
V	V	V
חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיק		

איפיון של מטלות ותהליכים

MSDS	תדירות שימוש	חומר	שם המרכיב	גורם חשיפה	כמות חומר זעירה
תהליך: שטיפה/ניקוי					
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה
					ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
					בקרת תהליך: אוורור כללי מנדף
מרכיבים בתהליך:					
V	יומית	איזופרופיל אלכוהול			
		איזופרופיל אלכוהול			
V	יומית	אצטון			
		אצטון			
V	יומית	מתנול			
		מתנול			
תהליך: שטיפה/ניקוי- ניקוי צנטריפוגה					
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
					ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית
					בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:					
V	שבועית	כלורופורם			
		כלורופורם			
תהליך: הכנת תערובת- המסת פולימרים					
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
					ציוד מגן אישי: נשמית כפפות להגנה מחומרים
					בקרת תהליך: מנדף
מרכיבים בתהליך:					
V	שבועית	קסילן			
V		קסילן			
מחלקה: מעבדה הוראה ביואורגנית /קמפוס מרקוס /בניין 38 /חדר104,107,204,207					
מטלה: הוראה מספר עובדים: 1					
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- נדיר					
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, קיימת חשיפה עורית
					ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
					בקרת תהליך: אוורור כללי מנדף
סיכונים נוספים:					
מרכיבים בתהליך:					
V	נדיר	הקסן			
V		הקסן-נורמלי			
V	נדיר	חומצות			
		חומצה חנקתית			
		חומצה גופרתית			
		חומצה אצטית			
		חומצה הידרוכלורית			
V	נדיר	טולואן			
		טולואן			
תהליך: שטיפה/ניקוי					
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, קיימת חשיפה עורית
					ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
מרכיבים בתהליך:					
V	שבועית	אצטון			
		אצטון			
V	שבועית	אתנול			
		אתנול			

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה
אחוז מרכיב	

מחלקה: מעבדה לאיפיון חילבוניים ביאורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 313

מטלה: איפיון חילבוניים ביאורגנית מספר עובדים: 4

תהליך: הכנת תערובת- הכנת תמיסה	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית	
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית	
בקרת תהליך: מנדף אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל
V V	אצטוניטריל
3-4 פעמים בשבוע	מתנול
V V	מתנול
3-4 פעמים בשבוע	

תהליך: שטיפה/ניקוי	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית	
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית	
בקרת תהליך: אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אתנול
V	אתנול
יומית	

תהליך: תהליכי עזר - איחסון	
איפיון תהליך: משך תהליך: משמרת חלקית	
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית	
בקרת תהליך: מנדף	
מרכיבים בתהליך:	חומצה אצטית
V	חומצה אצטית
נדיר	חומצה גופרתית
V	חומצה גופרתית
נדיר	חומצה הידרוכלורית
V	חומצה הידרוכלורית
נדיר	

מחלקה: מעבדה לביוטכנולוגיה / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 210	
מטלה: מחקר ביאוטכנולוגיה מספר עובדים: 25	
תהליך: בדיקה בקטריוולוגית- סינטזה	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית	
בקרת תהליך: אוורור כללי מנדף	
מרכיבים בתהליך:	כלורופורם
V V	כלורופורם
חודשית	
תהליך: שטיפה/ניקוי	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית	
בקרת תהליך: אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אצטון
V V	אצטון
יומית	

איפיון של מטלות ותהליכים

MSDS	תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	חומר	גורם חשיפה	שם המרכיב
V	V	אחוז מרכיב	חודשית	חומצה גופרתית	מי חמצן
הכנת תערובת- פיראנה					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית					
כפפות להגנה מחומרים					
מנדף					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	חודשית	חומצה גופרתית	חומצה גופרתית	מי חמצן
בדיקה בקטריוולוגית- בדיקות תאים					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית					
כפפות להגנה מחומרים					
נשמית					
מנדף					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	שבועית	חומצה הידרוכלורית	חומצה הידרוכלורית	חומצה הידרוכלורית
מחלקה:					
מעבדה לביאוטכנולוגיה /קמפוס מרקוס /בניין 39 /חדר 219,223					
מטלה:					
ביאוטכנולוגיה					
מספר עובדים: 5					
בדיקות כימיות-ללא מכשור- צביעה					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
נשמית					
אזור כללי					
מנדף					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	שבועית	קסילן	קסילן	קסילן
שטיפה/ניקוי					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
אזור כללי					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	יומית	אצטון	אצטון	אצטון
בדיקות פיזיקליות- מגנטים					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
אזור כללי					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	שבועית	ברזל כלוריד	ברזל כלוריד	ברזל כלוריד
חלקיקים בלתי מסווגים					
V	V	שבועית	חומצה הידרוכלורית	חומצה הידרוכלורית	חומצה הידרוכלורית
שקילה					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
אזור כללי					
תהליך:					
איפיון תהליך:					
ציוד מגן אישי:					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
V	V	נדיר	סודיום סולפיט	סודיום סולפיט	סודיום סולפיט

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		

הרדמה- התהליך מתבצע בחדר 005

תהליך: הרדמה- התהליך מתבצע בחדר 005

איפיון תהליך: שיטה: ממוכן בהפעלה צמודה של עובד, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: מנדף

	איזופלורן	
V	נדיף	מרכיבים בתהליך:

מחלקה: מעבדה לביולוגיה תאים DNA / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 002	מטלה: ביולוגיה תאים DNA
מספר עובדים: 4	

תהליך: הרצה- הרצת ג'יל

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: נשמית

מרכיבים בתהליך: מנדף

	ETHIDIUM BROMIDE	
V	3-4 פעמים בשבוע	מרכיבים בתהליך:
V	ETHIDIUM BROMIDE	
V	3-4 פעמים בשבוע	מרכיבים בתהליך:
V	אקרילאמיד	
V	אקרילאמיד	

תהליך: יצוב/קיבוע (fixation) - צביעה של רקמות

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: נשמית

מרכיבים בתהליך: אזורר כללי

	פורמאלדהיד	
V	3-4 פעמים בשבוע	מרכיבים בתהליך:
V	פורמאלדהיד	

תהליך: שקילה

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורר כללי

מרכיבים בתהליך: אזורר כללי

	סודיום סולפיט	
V	3-4 פעמים בשבוע	מרכיבים בתהליך:
V	סודיום סולפיט	

מחלקה: מעבדה לחקר קיפול חלבונים/קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 120	מטלה: חקר קיפול חלבונים
מספר עובדים: 11	

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- חקר קיפול חלבונים

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורר כללי

מרכיבים בתהליך: אזורר כללי

	חומצה הידרוכלורית	
V	יומית	מרכיבים בתהליך:
V	חומצה הידרוכלורית	
V	סודיום סולפיט	מרכיבים בתהליך:
V	סודיום סולפיט	

איפיון של מטלות ותהליכים

	תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	MSDS	חומר	גורם חשיפה
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- הפקה RNA, DNA					
				שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה	
				כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
				אזורור כללי	בקרת תהליך:
				מנדף	
V	V	3-4 פעמים בשבוע		אתנול	מרכיבים בתהליך:
				אתנול	
V	V	3-4 פעמים בשבוע		מתנול	
				מתנול	
תהליך: הרצה- הרצת גיל					
				שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
				כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
				אזורור כללי	בקרת תהליך:
				מנדף	
V	V	3-4 פעמים בשבוע		ACRYLIC POLYMER	מרכיבים בתהליך:
				ACRYLIC POLYMER	
V	V	3-4 פעמים בשבוע		ETHIDIUM BROMIDE	
				ETHIDIUM BROMIDE	
תהליך: הכנת תערובת					
				שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
				כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
				נשמית	
				מנדף	בקרת תהליך:
V	V	שבועית		איזופרופיל אלכוהול	מרכיבים בתהליך:
				איזופרופיל אלכוהול	
V	V	שבועית		דימסול	
				דימתיל סולפוקסיד	
				כלורפורם	
V	V	שבועית		פאראפורמאלדהיד	
				פאראפורמאלדהיד	
מחלקה: מעבדה לננוביוטכנולוגיה / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 206					
מטלה: מחקר של ננוביוטכנולוגיה מספר עובדים: 8					
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- כימיה פני שטח					
				שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
				כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
				מנדף	בקרת תהליך:
				אזורור כללי	
V	V	שבועית		אצטוניטריל	מרכיבים בתהליך:
				אצטוניטריל	
V	V	שבועית		די - מתיל פורמאמיד	
				די - מתיל פורמאמיד	
תהליך: שטיפה/ניקוי					
				שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
				כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
				אזורור כללי	בקרת תהליך:
V	V	שבועית		פיראנה	מרכיבים בתהליך:
				חומצה גופרתית	
				מי חמצן	

איפיון של מטלות ותהליכים

<i>MSDS</i> כמות חומר זעירה	תדירות שימוש	חומר	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	גורם חשיפה	
תהליך: בדיקות כימיות-ללא מכשור			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	חודשית	איזופרופיל אלכוהול	מרכיבים בתהליך:
		איזופרופיל אלכוהול	
V	חודשית	איזופרופיל אצטט	
		איזופרופיל אצטט	

מחלקה: מעבדה לפיזיולוגיה וביולוגיה מולקולרית של חסרי חוליות/קמפוס מרקוס /בניין 39 /חדר 227

מטלה: מחקר פיזיולוגיה וביולוגיה מולקולרית של חסרי חוליות מספר עובדים: 6

תהליך: הרצה- הרצת גיל			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	שבועית	ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:
		ETHIDIUM BROMIDE	

תהליך: שטיפה/ניקוי- ניקוי חלבונים			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	חודשית	מתנול	מרכיבים בתהליך:
		מתנול	

תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC			
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: אוורור כללי			
V	V	חודשית	אצטוניטריל
			אצטוניטריל

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- הפקת RNA			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	V	שבועית	איזופרופנול
			איזופרופיל אלכוהול
V	V	שבועית	כלורופורם
			כלורופורם
V	V	שבועית	פנול
			פנול

איפיון של מטלות ותהליכים

	חומר	תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	MSDS
	גורם חשיפה	אחוז מרכיב	שם המרכיב	
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- פרפורציה				
	איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים		
	בקרת תהליך:	אוורור כללי		
V	V	שבועית		קסילן
				קסילן
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- השקעה חלבונים				
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים		
	בקרת תהליך:	מנדף		
V	V	10 חודשית		כלורופורם
				כלורופורם
תהליך: שטיפה/ניקוי				
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה		
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים		
	בקרת תהליך:	אוורור כללי		
V	V	יומית		איזופרופיל אלכוהול
				איזופרופיל אלכוהול
תהליך: צביעה- גיל				
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים		
	בקרת תהליך:	מנדף		
		אוורור כללי		
V	V	חודשית		אתנול
				אתנול
V	V	חודשית		חומצה אצטית
				חומצה אצטית
V	V	חודשית		קסילן
				קסילן
תהליך: הכנת תערובת- המסה				
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים		
	בקרת תהליך:	אוורור כללי		
V	V	חודשית		דיומסול
				כלורופורם
				דימתיל סולפוקסיד

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה לתרביות תאים / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 325	
מטלה: מחקר של תרביות תאים	מספר עובדים: 10

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- הפקת RNA	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	אתנול
V V יומית	אתנול
V V יומית	כלורופורם
	כלורופורם

תהליך: יצוב/קיבוע (fixation) - פיקסציה	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	איזופרופיל אלכוהול
V V יומית	איזופרופיל אלכוהול
V V יומית	מתנול
	מתנול

תהליך: שטיפה/ניקוי	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	אתנול
V V יומית	אתנול

מחלקה: מעבדה לגנטיקה/קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 126	
מטלה: מחקר גנטיקה	מספר עובדים: 6

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- הפקת RNA	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	כלורופורם
V V חודשית	כלורופורם

תהליך: שטיפה/ניקוי	
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך: אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	איזופרופיל אלכוהול
V V יומית	איזופרופיל אלכוהול
V V יומית	אתנול
	אתנול
V V יומית	מתנול
	מתנול

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה MSDS	חומר גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	
תהליך: הרצה- הרצת גיל		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף אוורור כללי		
V	V	מרכיבים בתהליך: שבועית ETHIDIUM BROMIDE
ETHIDIUM BROMIDE		

מחלקה: מעבדה קריסטלוגרפיה /קמפוס מרקוס /בניין 39 /חדרים 009-010	מטלה: מחקר של קריסטלוגרפיה
מספר עובדים: 15	

תהליך: שקילה- עופר		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	V	מרכיבים בתהליך: עופרת עופרת - אנאורגנית
3-4 פעמים בשבוע		

תהליך: מיצוי- ליפידים		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	V	מרכיבים בתהליך: כלורופורם כלורופורם
שבועית		

תהליך: הכנת תערובת		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	V	מרכיבים בתהליך: גלוטראלדהיד גלוטראלדהיד
10 חודשית		

מחלקה: מעבדה לנירואימונולוגיה /קמפוס מרקוס /בניין 39	מטלה: מחקר ניירואימונולוגיה
מספר עובדים: 10	

תהליך: גריסה/טחינה- מוח של עכברים		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	V	מרכיבים בתהליך: איזופרופיל אלכוהול איזופרופיל אלכוהול
חודשית		
V	V	פנול פנול
חודשית		

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS	
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב	אחוז מרכיב
תהליך:			
בדיקות כימיות-ללא מכשור- קיבוע			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: אזור כללי מנדף			
V	V	חודשית	פורמאלין פורמאלדהיד
תהליך:			
הרצה- ג'יל			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: נשמית מנדף			
V	V	3-4 פעמים בשבוע	בטא-מרקפטו-אתנול
2-MERCAPTOETHANOL			
V	V	שבועית	מתנול מתנול
20.00%			
תהליך:			
הרדמה- מכונה			
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש:			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: נשמית אזור כללי			
V	V	יומית	איזופלורן איזופלורן
5.00%			
מחלקה: מעבדה למחקר לחומרים וביוטכנולוגיה /קמפוס מרקוס /בניין 39 /חדר 215			
מטלה: מחקר לחומרים וביוטכנולוגיה מספר עובדים: 4			
תהליך:			
הכנת תערובת- פיראנה ניקוי			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	V	חודשית	פיראנה מי חמצן חומצה גופרתית
תהליך:			
שטיפה/ניקוי			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: אזור כללי			
V	V	יומית	אתנול אתנול
V	V	חודשית	ציקלוקסון ציקלוקסון

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה MSDS	חומר גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	
תהליך: הכנת תערובת		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
בקרת תהליך: מנדף		
V	נדיר	מרכיבים בתהליך: כלורופורם כלורופורם

מחלקה: מעבדה לתאי דלק מיקרוביאליים / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 301	מטלה: מחקר תאי דלק מיקרוביאליים
מספר עובדים: 12	

תהליך: מיצוי- חיידקים		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	V	מרכיבים בתהליך: חומצות
	שבועית	חומצה גופרתית
	5.00%	חומצה אצטית
	1.00%	חומצה הידרוכלורית
	3.00%	

מחלקה: מעבדה לביוכימיה וסרטן / קמפוס מרקוס / בניין 39 / חדר 317	מטלה: מחקר ביוכימיה וסרטן
מספר עובדים: 3	

תהליך: הרצה- ג'יל		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עורית		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי מנדף		
V	V	מרכיבים בתהליך: SDS
	נדיר	אתנול
	SODIUM DODECYL SULFATE	מתנול
	V	
	3-4 פעמים בשבוע	
	V	
	3-4 פעמים בשבוע	

תהליך: שקילה		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים נשמית		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	חודשית	מרכיבים בתהליך: מלחים
	SODIUM CHLORIDE	

תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC		
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: בינונית		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	חודשית	מרכיבים בתהליך: אצטוניטריל אצטוניטריל

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	

	תהליך: הכנת תערובת	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
V V	מרכיבים בתהליך: אקרילאמיד	שבועית
	אקרילאמיד	

מחלקה: מעבדה ביולוגיה של עקות סביבתיות בצמחים/קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 216	מטלה: מחקר
מספר עובדים: 7	

	תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- גידול צמחים	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: מנדף	
V V	מרכיבים בתהליך: כלורופורם	חודשית
	כלורופורם	
V V	פנול	נדיר
	פנול	

מחלקה: הנדסה גינטית של חלבונים/קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 014,016	מטלה: אבולוציה מכוונת של חלבונים
מספר עובדים: 6	

	תהליך: הרצה- ג'יל	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: מנדף	
V V	מרכיבים בתהליך: אתידיום ברומיד	שבועית
	ETHIDIUM BROMIDE	

	תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
V V	מרכיבים בתהליך: אנטיביוטיקות	שבועית

	תהליך: שטיפה/ניקוי- חיטוי	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
V	מרכיבים בתהליך: אתנול	יומית
	אתנול	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: המעבדה לנירוביולוגיה מולקולרית וביופיסית/קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדר 314	
מטלה: חקר האינטרקציה הבין ותור מולקולרית של התעלה לא	
מספר עובדים: 8	

	תהליך:	שטיפה/ניקוי- חיטוי
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	יומית	אתנול
		אתנול

	תהליך:	הכנת תערובת
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	נדיר	חומצה אצטית
V		חומצה אצטית

	תהליך:	הרצה- ג'יל
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	חודשית	אתידיום ברומיד
V		ETHIDIUM BROMIDE
V	חודשית	פנול
		פנול

מחלקה: מעבדה לחקר תהליכי התפתחות ופריחה בצמחים /קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדר 214	
מטלה: מנגנונים מולקולריים בבסיס התפתחות ה פרח	
מספר עובדים: 6	

	תהליך:	שטיפה/ניקוי- חיטוי
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	יומית	אתנול
		אתנול

	תהליך:	בדיקות כימיות ממוכשרות-אחרות- הפקת DNA/RNA
	איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	3-4 פעמים בשבוע	איזופרופיל אלכוהול
		איזופרופיל אלכוהול
V	3-4 פעמים בשבוע	בוטנול
		בוטנול-נורמלי
V	3-4 פעמים בשבוע	די - מתיל פורמאמיד
		די - מתיל פורמאמיד

איפיון של מטלות ותהליכים

MSDS	תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	חומר	גורם חשיפה	שם המרכיב
V	V	שבוטית	פורמלין	פורמאלדהיד	תהליך: יצוב/קיבוע (fixation)
		4.00%			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר (STEL), כמות חומר בשימוש: מועטה ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים בקרת תהליך: מנדף
					תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים בקרת תהליך: אזור כללי
V	V	3-4 פעמים בשבוע	פנול	פנול	מרכיבים בתהליך:
					תהליך: הרצה- ג'יל
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים בקרת תהליך: מנדף
V	V	שבוטית	אתידיום ברומיד	ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:
מחלקה: מעבדה לביוגינזה של חלבונים בארכיאה /קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדר 102					
מטלה: ביוגנזה של חלבונים בארכיאה מספר עובדים: 5					
					תהליך: הרצה- ג'יל
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים בקרת תהליך: מנדף
V	V	3-4 פעמים בשבוע	אתידיום ברומיד	ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:
					תהליך: מיצוי
					איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים בקרת תהליך: מנדף
V	V	10 חודשית	כלורופורם	כלורופורם	מרכיבים בתהליך:

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורור כללי
מנדף

V	V	יומית	אצטון	מרכיבים בתהליך:
			אצטון	
V	V	יומית	אתנול	
			אתנול	
V	V	יומית	חומצה אצטית	
			חומצה אצטית	
V	V	יומית	מתנול	
			מתנול	

תהליך: שקילה

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
גשמית

בקרת תהליך: אזורור כללי

V	V	נדיר	SDS	מרכיבים בתהליך:

SODIUM DODECYL SULFATE

מחלקה: מעבדה לביולוגיה מולקולרית / קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 006

מספר עובדים: 6

מטלה: גינומיקה של צמחים

תהליך: מיצוי- DNA/RNA

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורור כללי

V	V	שבועית	חומצה הידרוכלורית	מרכיבים בתהליך:
			חומצה הידרוכלורית	
V	V	שבועית	מתנול	
			מתנול	

תהליך: שטיפה/ניקוי- חיטוי

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורור כללי

V	V	יומית	אתנול	מרכיבים בתהליך:
			אתנול	

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך: אזורור כללי

V	V	יומית	מלחים	מרכיבים בתהליך:

SODIUM CHLORIDE

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS	
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב	אחוז מרכיב
תהליך: הפרדה כימית			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	V	שבועית	חומצה בורית
		BORIC ACID	מרכיבים בתהליך:

תהליך:
איפיון תהליך:

מחלקה: מעבדה לביופיזיקה של מיקרואורגניזמים / קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 116	מטלה: ביוכימיה מולקולרית
מספר עובדים: 8	

תהליך: הרצה- גיל			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	V	שבועית	ETHIDIUM BROMIDE
		ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: אוורור כללי			
V	V	3-4 פעמים בשבוע	מלחים
		SODIUM NITRATE	מרכיבים בתהליך:
		SODIUM SULFATE	

מחלקה: מעבדה לגנטיקה ואבולוציה מיטוכונדרית / קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 004	מטלה: מחקר גנטיקה ואבולוציה מיטוכונדרית
מספר עובדים: 7	

תהליך: הרצה- גיל			
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה			
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים			
בקרת תהליך: מנדף			
V	V	3-4 פעמים בשבוע	ETHIDIUM BROMIDE
		ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה
אחוז מרכיב	
מחלקה: מעבדה למבנה של מאקרומולקולות/קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדר 002	
מטלה: קריסטלוגרפיה של חלבונים	
מספר עובדים: 4	

		שטיפה/ניקוי- ג'ל	תהליך:		
		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	איפיון תהליך:		
		כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:		
		אזור כללי	בקרת תהליך:		
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:	מתנול	
				מתנול	

		עבודות מחקר ופיתוח-אחר	תהליך:		
		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	איפיון תהליך:		
		כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:		
		אזור כללי	בקרת תהליך:		
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:	איזופרופיל אלכוהול	
				איזופרופיל אלכוהול	
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:	אתידיום ברומיד	
				ETHIDIUM BROMIDE	
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:	חומצות	
				חומצה הידרוכלורית	
				חומצה אצטית	
	V	יומית	מלחים		
				NICKEL CHLORIDE	
				NICKEL SULFATE	
				SODIUM CHLORIDE	

מחלקה: מעבדה למיקרוביולוגיה מולקולרית/קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדר 210	
מטלה: מיקרוביולוגיה	
מספר עובדים: 8	

		בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC	תהליך:		
		שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה	איפיון תהליך:		
		כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:		
		אזור כללי	בקרת תהליך:		
V	V	חודשית	מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל	
				אצטוניטריל	

		עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה	תהליך:		
		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	איפיון תהליך:		
		כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:		
		מנדף	בקרת תהליך:		
V	V	שבועית	מרכיבים בתהליך:	חומצה אצטית	
				חומצה אצטית	
	V	3-4 פעמים בשבוע	מתנול		
			מתנול		

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	

	הרצה- ג'ל	
	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	מרכיבים בתהליך:
	שבועית	ETHIDIUM BROMIDE
	ETHIDIUM BROMIDE	

מחלקה: מעבדה לנירופיזיולוגיה התנהגותית / קמפוס מרקוס/ בניין 40 / חדר 316	מטלה: נירופיזיולוגיה התנהגותית
מספר עובדים: 4	

	תהליך:	
	איפיון תהליך:	יצוב/קיבוע (fixation) שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	מרכיבים בתהליך:
	חודשית	חומצה אצטית
		חומצה אצטית
V	חודשית	פורמלין
		פורמאלדהיד

	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שטיפה/ניקוי- חיטוי שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	V	מרכיבים בתהליך:
	יומית	אתנול
		אתנול

מחלקה: מעבדה לטיפול לישמניה והאצה כלמידומנס / קמפוס מרקוס/ בניין 40/ חדרים 135,138,137	מטלה: מנגנון תרגום בטיפול לישמניה
מספר עובדים: 6	

	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שטיפה/ניקוי- חיטוי שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
V	V	מרכיבים בתהליך:
	יומית	אתנול
		אתנול

	תהליך:	
	איפיון תהליך:	הכנת תערובת שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	מרכיבים בתהליך:
	נדיר	חומצה אצטית
		חומצה אצטית
V	V	מלחים
	שבועית	
		SODIUM CHLORIDE

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה שם המרכיב	חומר גורם חשיפה	
MSDS		
אחוז מרכיב		
		הרצה- ג'ל
		תהליך:
		איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: מנדף
V	V	אתידיום ברומיד
	חודשית	
	ETHIDIUM BROMIDE	
V	V	פנול
	חודשית	
		פנול
מחלקה: מעבדה חקר תעלות אשלגן /קמפוס מרקוס/בניין 40 /חדרים 305,306		
מטלה: פיזיולוגיה מולקולרית		
מספר עובדים: 6		

		מיצוי- DNA/RNA	תהליך:
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: מנדף
V	V	כלורופורם	מרכיבים בתהליך:
	שבועית		
		כלורופורם	
V	V	מתנול	
	שבועית		
		מתנול	

		שטיפה/ניקוי- חיטוי	תהליך:
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: אוורור כללי
V	V	איזופרופיל אלכוהול	מרכיבים בתהליך:
	יומית		
		איזופרופיל אלכוהול	
V	V	אצטון	
	יומית		
		אצטון	

		הרצה- גיל	תהליך:
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: מנדף
V	V	ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:
	שבועית		
		ETHIDIUM BROMIDE	

		הפרדה כימית- המסה	תהליך:
			איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
			ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
			בקרת תהליך: אוורור כללי
V	V	מלחים	מרכיבים בתהליך:
	שבועית		
		MAGNESIUM CHLORIDE	
		POTASSIUM CHLORIDE	
		SODIUM CHLORIDE	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה	כמות חומר זעירה

	בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC	
תהליך:	איפיון תהליך:	ציוד מגן אישי:
מרכיבים בתהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה	כפפות להגנה מחומרים
אצטוניטריל	אצטוניטריל	אזור כללי
נדיך	V	V

	הרדמה- בזריחה	
תהליך:	איפיון תהליך:	ציוד מגן אישי:
מרכיבים בתהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	כפפות להגנה מחומרים
אצטוניטריל	אצטוניטריל	אזור כללי

	הכנת תערובת	
תהליך:	איפיון תהליך:	ציוד מגן אישי:
מרכיבים בתהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי, כמות חומר בשימוש: מועטה	כפפות להגנה מחומרים
חומצה אצטית	חומצה אצטית	מנדף
שבועית	V	V
מתנול	מתנול	מנדף
שבועית	V	V

מחלקה: מעבדה פיזיולוגיה מולקולרית / קמפוס מרקוס / בניין 40 / חדר 302	מטלה: גרימת תמותת תאי סרטן
מספר עובדים: 10	

	הרצה- ג'ל	
תהליך:	איפיון תהליך:	ציוד מגן אישי:
מרכיבים בתהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	כפפות להגנה מחומרים
ETHIDIUM BROMIDE	ETHIDIUM BROMIDE	מנדף
שבועית	V	V

	שטיפה/ניקוי- חיטוי	
תהליך:	איפיון תהליך:	ציוד מגן אישי:
מרכיבים בתהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	כפפות להגנה מחומרים
אתנול	אתנול	אזור כללי
יומית	V	V

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה		
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	אזורור כללי מנדף	
מרכיבים בתהליך:	SDS	נדיר
		V V
		SODIUM DODECYL SULFATE
מלחים		V V יומית
		MAGNESIUM CHLORIDE
		SODIUM CHLORIDE
		POTASSIUM CHLORIDE
מתנול		V יומית
		מתנול

מחלקה: מעבדה אופטיקה וספטרסקופיה /קמפוס מרקוס /בניין 51 /חדר 104	מטלה: מדידת חומרים במיקרוסקופיה
מספר עובדים: 1	

תהליך: שטיפה/ניקוי		
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	אזורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אתנול	V יומית
		אתנול

מחלקה: מעבדה אנליטית /קמפוס מרקוס/בנין 51/חדרים 230,223	מטלה: בדיקות אנליטיות כשירות פנים וחוץ /חדר 230
מספר עובדים: 4	

תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC- נגו HPLC		
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	אזורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל	V V יומית
		אצטוניטריל
	מתנול	V V יומית
		מתנול

תהליך: הכנת תערובת- דוגמאות		
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	מנדף	
מרכיבים בתהליך:	כלורופורם	V V יומית
		כלורופורם

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	שם המרכיב	
MSDS	כמות חומר זעירה	אחוז מרכיב	גורם חשיפה
בדיקות כימיות ממוכשרות-אחרות- GPC			
תהליך:		איפיון תהליך:	
שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה		ציוד מגן אישי:	
כפפות להגנה מחומרים		בקרת תהליך:	
אוורור כללי		מרכיבים בתהליך:	
V	V	3-4 פעמים בשבוע	די - כלורואתן
			די - כלורואתן (1,1)
V	V	3-4 פעמים בשבוע	מתנול
			מתנול
20.00%			
שטיפה/ניקוי			
תהליך:		איפיון תהליך:	
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		ציוד מגן אישי:	
כפפות להגנה מחומרים		בקרת תהליך:	
אוורור כללי		מרכיבים בתהליך:	
V	V	יומית	אצטון
			אצטון
V	V	יומית	אתנול
			אתנול

מחלקה: מעבדה לביופיזית ואנליזות תרמית / בניין 51 / חדרים 123,127

מספר עובדים: 4

מטלה: אנליזות תרמיות

הכנת תערובת- המסה ליפידים			
תהליך:		איפיון תהליך:	
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		ציוד מגן אישי:	
כפפות להגנה מחומרים		בקרת תהליך:	
מנדף		מרכיבים בתהליך:	
V	V	שבועית	אתנול
			אתנול
V	V	שבועית	כלורופורם
			כלורופורם
V	V	שבועית	מתנול
			מתנול
שטיפה/ניקוי			
תהליך:		איפיון תהליך:	
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		ציוד מגן אישי:	
כפפות להגנה מחומרים		בקרת תהליך:	
אוורור כללי		מרכיבים בתהליך:	
V	V	יומית	אצטון
			אצטון

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה שם המרכיב	גורם חשיפה

תהליך:		עבודות מחקר ופיתוח-אחר
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		דיומסול
V	V	שבועית
		10.00%
הפטן		כלורופורם
V	V	3-4 פעמים בשבוע
		הפטן (נורמלי)
חומצה אצטית		חומצה אצטית
V	V	3-4 פעמים בשבוע
חומצה גופרתית		חומצה גופרתית
V	V	3-4 פעמים בשבוע
חומצה הידרוכלורית		חומצה הידרוכלורית
V	V	3-4 פעמים בשבוע
חומצה חנקתית		חומצה חנקתית
V	V	3-4 פעמים בשבוע
ציקלוקסן		ציקלוקסן

מחלקה: מעבדה להכנת דגמים לבדיקה במיקרוסקופ אלקטרוני/קמפוס מרקוס/בניין 51/חדר 005	מטלה: הכנת דגמים
מספר עובדים: 3	

תהליך:		שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: רגעי
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		אצטון
V	V	יומית
		אצטון
V	V	יומית
		אתנול
		אתנול
תהליך:		בדיקות כימיות ממוכשרות-אחרות-טיטרציה
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		חומצה אצטית
V	V	חודשית
		חומצה אצטית
V	V	חודשית
		חימצה הידרוכלורית
		חומצה הידרוכלורית

מחלקה: מעבדה לננוחומרים/קמפוס מרקוס/בניין 51/חדרים 309,312	מטלה: סינטזה של מוליכים למחצה
מספר עובדים: 7	

תהליך:		הכנת תערובת
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		הקסן
V	V	שבועית
		הקסן-נורמלי
V	V	שבועית
		מתכות
		גופרית
		זהב
		פלטינה-מלחים מסיסים
		נחושת (מתכת)

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה MSDS	חומר גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	
		תהליך: שטיפה/ניקוי
		איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: אוורור כללי
V	יומית	מרכיבים בתהליך: אתנול
		אתנול
V	יומית	טלואן
		טלואן
V	יומית	מתנול
		מתנול

מחלקה: מעבדה לסינתזה אורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 51 / חדרים 131,132

מטלה: סינתזה אורגנית ו פולימרים חדר 131 מספר עובדים: 3

		תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- סינטזה כימית
		איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: מנדף
V	שבועית	מרכיבים בתהליך: די - כלורואתן
		די - כלורואתן (1,1)
V	יומית	הקסן
		קסילן
V	יומית	כלורופורם
		כלורופורם

		תהליך: שטיפה/ניקוי
		איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: אוורור כללי
V	יומית	מרכיבים בתהליך: אצטון
		אצטון

		תהליך: הפרדה כימית
		איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: מנדף
V	יומית	מרכיבים בתהליך: תערובת (הקסן, אתיל אצטת)
		אתיל אצטט
		הקסן-נורמלי

מטלה: בדיקות ממוכשרות / חדר 132 מספר עובדים: 3

		תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC
		איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך: אוורור כללי
V	שבועית	מרכיבים בתהליך: אצטוניטריל
		אצטוניטריל

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	כמות חומר זעירה MSDS
אחוז מרכיב	גורם חשיפה	שם המרכיב
מחלקה: מעבדה לפרמקולוגיה מולקולרית / קמפוס מרקוס / בניין 51 / חדר 324		
מטלה: מחקר		מספר עובדים: 5

		תהליך:	שטיפה/ניקוי- חיטוי
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אוורור כללי
V	יומית	אתנול	מרכיבים בתהליך:
		אתנול	
		היפוכלוריד	
		כלור	
		מתנול	
		מתנול	
		תהליך:	יצוב/קיבוע (fixation)
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אוורור כללי
V	שבועית	אתנול	מרכיבים בתהליך:
		אתנול	
V	נדיר	פורמלין	
V	2.00%	פורמאלדהיד	
		תהליך:	מיצוי- DNA
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	מנדף
V	3-4 פעמים בשבוע	ETHIDIUM BROMIDE	מרכיבים בתהליך:
V	ETHIDIUM BROMIDE		
		תהליך:	צביעה- ג'ל
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	מנדף
V	יומית	חומצה אצטית	מרכיבים בתהליך:
V		חומצה אצטית	
		תהליך:	הכנת תערובת- המסה ליפידים
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	מנדף
V	חודשית	כלורופורם	מרכיבים בתהליך:
V		כלורופורם	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	
MSDS		
שם המרכיב	אחוז מרכיב	

	הרצה- ג'ל	
	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	SDS
	מרכיבים בתהליך:	
V	V	מלחים
	נדיר	
	SODIUM DODECYL SULFATE	
	יומית	
	SODIUM CHLORIDE	
	POTASSIUM CHLORIDE	

	מחלקה:	מעבדת ננו חומרים / קמפוס מרקוס / בניין 51 / חדר 306
	מטלה:	סינתזה של ננו חומרים מוליכים למחצה
		מספר עובדים: 2

	מיצוי- סינתזה רטובה	
	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	כלורופורם
	מרכיבים בתהליך:	כלורופורם
V	V	מתכות
	יומית	מנגן (מתכת ומלחים אי-אורגניים)
	יומית	ניקל (מתכת)
		עופרת - אנאורגנית

	מחלקה:	מעבדת פיזור / קמפוס מרקוס / בניין 51 / חדר 102
	מטלה:	איפיון גודר חלקיקים
		מספר עובדים: 3

	שטיפה/ניקוי- חיטוי	
	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	אזור כללי
	סיכונים נוספים:	קרינה מייננת
V	V	אצטון
	מרכיבים בתהליך:	אצטון
V	V	אתנול
	יומית	אתנול
V	V	הקסן
	יומית	הקסן-נורמלי

	עבודות מחקר ופיתוח-אחר	
	תהליך:	
	איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
	ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
	בקרת תהליך:	מנדף
V	V	איזופרופיל אלכוהול
	מרכיבים בתהליך:	איזופרופיל אלכוהול
V	V	טולואן
	יומית	טולואן
V	V	מתילן כלוריד
	שבועית	מתילן כלוריד

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	
כמות חומר זעירה שם המרכיב	גורם חשיפה	
MSDS		
אחוז מרכיב		
	שטיפה/ניקוי-הדשות	תהליך:
	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	איפיון תהליך:
	כפפות להגנה מחומרים	ציוד מגן אישי:
	מנדף	בקרת תהליך:
V V	שבועית	מרכיבים בתהליך:
	אתיל אתר	

מחלקה: מעבדת שכבות דקות /קמפוס מרקוס /בניין 51 /חדר 304	מטלה: מחקר של שכבות דקות
מספר עובדים: 6	

	שטיפה/ניקוי-חיטוי	
	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	תהליך:
	כפפות להגנה מחומרים	איפיון תהליך:
	אוורור כללי	ציוד מגן אישי:
		בקרת תהליך:
V	יומית	מרכיבים בתהליך:
		אתנול
		אתנול

	עבודות מחקר ופיתוח-אחר	
	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	תהליך:
	כפפות להגנה מחומרים	איפיון תהליך:
	אוורור כללי	ציוד מגן אישי:
	מנדף	בקרת תהליך:
V V	יומית	מרכיבים בתהליך:
	SODIUM SULFIDE	
	SODIUM SULFIDE	
V V	יומית	חומצה חנקתית
		חומצה חנקתית
V V	יומית	עופרת אצטט
	LEAD (II) ACETATE	

מחלקה: מעבדה לפיזיקה מולקולרית /קמפוס מרקוס /בניין 54 /חדר 112,011	מטלה: פיזיקה מולקולרית
מספר עובדים: 2	

	שטיפה/ניקוי	
	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	תהליך:
	כפפות להגנה מחומרים	איפיון תהליך:
	אוורור כללי	ציוד מגן אישי:
		בקרת תהליך:
V V	יומית	מרכיבים בתהליך:
		אצטון
		אצטון
V V	שבועית	טלואן
		טלואן

	בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC	
	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה	תהליך:
	כפפות להגנה מחומרים	איפיון תהליך:
	אוורור כללי	ציוד מגן אישי:
		בקרת תהליך:
V V	נדיר	מרכיבים בתהליך:
	DIMETHYL SULFATE	
	DIMETHYL SULFATE	
V V	נדיר	אצטוניטריל
		אצטוניטריל

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	MSDS
חומר	שם המרכיב	אחוז מרכיב
גורם חשיפה		
מחלקה: מעבדת ביופיזיקה/קמפוס מרקוס / בניין 54 / חדר 009		
מטלה: ניסויים ביופיסים		מספר עובדים: 8

תהליך:	הרצה- גל
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	אזורור כללי
מרכיבים בתהליך:	ETHIDIUM BROMIDE
	יומית
	ETHIDIUM BROMIDE
	V V

תהליך:	שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	מנדף אזורור כללי
מרכיבים בתהליך:	חומצה גופרתית
	חומצה גופרתית
	3-4 פעמים בשבוע
	V V
טלואן	
	3-4 פעמים בשבוע
	V V
	טלואן

מחלקה: מעבדה לגיאוכימיה אורגנית /קמפוס מרקוס / בניין 58 / חדרים 232,234		
מטלה: חדר מכשירים		מספר עובדים: 4

תהליך:	בדיקות כימיות-ממוכשרות-GC
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	אזורור כללי
מרכיבים בתהליך:	H2S
	מימן גופרי
	שבועית
	V

תהליך:	חיתוך- חיטוח סלע
איפיון תהליך:	שיטה: ממוכן בהפעלה צמודה של עובד, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	אוזניות נשמית
בקרת תהליך:	אזורור כללי יניקה מקומית מיזוג אוויר
סיכונים נוספים:	רעש מזיק

מטלה: גיאוכימיה של נפט, גז וסלעי מקור (חדר 232)		מספר עובדים: 4
--	--	----------------

תהליך:	הפרדה כימיה - זיקוק- סלע
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	מנדף
מרכיבים בתהליך:	אתילן גליקול
	אתילן גליקול
	יומית
	20.00%
	V V
חומצה זרחתית	
	יומית
	50.00%
	V V
	חומצה זרחתית

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה MSDS	חומר גורם חשיפה	
שם המרכיב	אחוז מרכיב	
שריפה- מכשיר (1300 ROCK EVOL מאלות)		
תהליך:		
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	שבועית	גזי שריפה
		מימן גופרי
		פחמן חד-חמצני
		גופרית דו חמצנית
		חנקן דו-חמצני
המלצה/סיכום: מומלץ להתקין מערכת יניקה או מנדף		
תהליך: שטיפה/ניקוי		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	יומית	אתנול
		אתנול
תהליך: הפרדה כימיה - זיקוק- זיקוק		
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
מרכיבים בתהליך:		
		גזים
		מימן גופרי
		גופרית דו חמצנית
		פחמן דו-חמצני (סביבתי)
		פחמן חד-חמצני
		נפטא
		נפטא VM & P
תהליך: מיצוי		
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש:		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
אוורור כללי		
מיזוג אוויר		
V	שבועית	טולואן
		טולואן
V	שבועית	מתילן כלוריד
		מתילן כלוריד

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	כמות חומר זעירה MSDS
אחוז מרכיב	גורם חשיפה	שם המרכיב
מחלקה: מעבדה כימית / קמפוס מרקוס / בניין 59 / חדר 043		
מטלה: הכנת תערובות		מספר עובדים: 12

									תהליך:
									איפיון תהליך:
									ציוד מגן אישי:
									בקרת תהליך:
									מרכיבים בתהליך:
V	V	דו חודשית	חומצה גופרתית	25.00%	חומצה גופרתית				
V	V	חודשית	חומצה הידרוכלורית		חומצה הידרוכלורית				
V	V	חודשית	חומצה הידרופלואורית	10.00%	חומצה הידרופלואורית (כ-פלור)				
V	V	דו חודשית	חומצה זרחתית	20.00%	חומצה זרחתית				
V	V	דו חודשית	חומצה חנקתית	20.00%	חומצה חנקתית				

מחלקה: מעבדה לביוחומרים ויישומים רפואיים / קמפוס מרקוס / בניין 59 / חדר 334		
מטלה: מערכת פולימרים לשחרור מבוקר של תרופות		מספר עובדים: 10

									תהליך:
									איפיון תהליך:
									ציוד מגן אישי:
									בקרת תהליך:
									מרכיבים בתהליך:
V	V	נדיר	מתנול		מתנול				

									תהליך:
									איפיון תהליך:
									ציוד מגן אישי:
									בקרת תהליך:
									מרכיבים בתהליך:
V	V	חודשית	חומצה הידרוכלורית		חומצה הידרוכלורית				

									תהליך:
									איפיון תהליך:
									ציוד מגן אישי:
									בקרת תהליך:
									מרכיבים בתהליך:
V	V	נדיר	DMSO		כלורופורם				

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	שטופה/ניקוי- חיטוי	
כמות חומר זעירה שם המרכיב	MSDS אחוז מרכיב	גורם חשיפה	
		תהליך:	
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אזור כללי
V	יומית	אתנול	מרכיבים בתהליך:
		אתנול	

מחלקה: מעבדה לחומרים מורכבים /קמפוס מרקוס /בניין 59 /חדר 335	מטלה: דיספרסיות
מספר עובדים: 8	

		תהליך:	
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אזור כללי
V	יומית	אצטון	מרכיבים בתהליך:
		אצטון	
V	יומית	אתנול	
		אתנול	

		תהליך:	
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אזור כללי
V	נדיר	PALLADIUM CHLORIDE	מרכיבים בתהליך:
V	PALLADIUM CHLORIDE		
V	נדיר	חומצה הידרוכלורית	
		חומצה הידרוכלורית	
V	נדיר	חומצה חנקתית	
		חומצה חנקתית	

מחלקה: מעבדה לראולוגיה ופולימרים /קמפוס מרקוס /בניין 59	מטלה: מחקר של פולימרים (חדר 307)
מספר עובדים: 6	

		תהליך:	
		איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת מלאה, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אזור כללי
V	שבועית	הקסן	מרכיבים בתהליך:
		הקסן-נורמלי	
V	שבועית	טולואן	
		טולואן	

		תהליך:	
		איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
		ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
		בקרת תהליך:	אזור כללי
V	חודשית	אצטון	מרכיבים בתהליך:
		אצטון	
V	חודשית	טולואן	
		טולואן	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה
אחוז מרכיב	

מחלקה: מעבדה לתהליכי הפרדה / קמפוס מרקוס / בניין 59 / חדרים 219,217,343,338

מספר עובדים: 2

מטלה: הפרדת חומרים

מרכיבים במטלה:	אתנול	אתנול	יומית
	אתנול		V

הפרדה כימית- אלקטרוכימיה

תהליך:

איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי:

כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך:

מנדף

מרכיבים בתהליך:	חומצה גופרתית	חודשית	V
	חומצה גופרתית		V

מרכיבים בתהליך:	מלחים	חודשית	V
	SODIUM CHLORIDE		V
	POTASSIUM CHLORIDE		

עבודות מחקר ופיתוח-אחר- יצור אלקטרודות

תהליך:

איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי:

כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך:

מנדף

מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל	חודשית	V
	אצטוניטריל		V

מרכיבים בתהליך:	מימן גופרי	יומית	V
	מימן גופרי		V

מרכיבים בתהליך:	פחם	חודשית	V
	פחם		V

מרכיבים בתהליך:	פלטינה-מתכת	חודשית	V
	פלטינה-מתכת		V

שטיפה/ניקוי

תהליך:

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי:

כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך:

אוורור כללי

מרכיבים בתהליך:	מתנול	יומית	V
	מתנול		

מחלקה: מעבדת פריחות מימנית / קמפוס מרקוס / בניין 59 / חדר 142

מספר עובדים: 1

מטלה: מחקר

עבודות מחקר ופיתוח-אחר- עיקול דגמים

תהליך:

איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה

ציוד מגן אישי:

כפפות להגנה מחומרים

בקרת תהליך:

מנדף

מרכיבים בתהליך:	חומצה גופרתית	חודשית	V
	חומצה גופרתית		V

מרכיבים בתהליך:	חומצה הידרוכלורית	חודשית	V
	חומצה הידרוכלורית		V

מרכיבים בתהליך:	חומצה הידרופלואורית	חודשית	V
	חומצה הידרופלואורית (כ-פלור)		V

מרכיבים בתהליך:	חומצה חנקתית	חודשית	V
	חומצה חנקתית		V

98.00%

32.00%

32.00%

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש כמות חומר זעירה MSDS	חומר גורם חשיפה	שם המרכיב אחוז מרכיב
תהליך: שטיפה/ניקוי		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: אוורור כללי		
V	יומית	אצטון
V	יומית	אצטון
V	יומית	מתנול
		מתנול

מחלקה: מעבדה ביופיסית / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדר 107

מטלה: מחקר מספר עובדים: 2

תהליך: מיצוי- סינטזה נגו חילבונים		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	שבועית	איזופרופיל אלכוהול
V	שבועית	איזופרופיל אלכוהול
V	שבועית	אתנול
		אתנול
V	שבועית	כלורופורם
		כלורופורם

תהליך: שטיפה/ניקוי		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	יומית	אצטון
		אצטון
V	שבועית	מתנול
		מתנול

תהליך: הכנת תערובת		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	שבועית	חומצות
		חומצה חנקתית
		חומצה גופרתית
		חומצה הידרוכלורית

מחלקה: מעבדה לאלקטרוכימיה / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדר 302

מטלה: תחונות אלקטרוכימיות של חומרים אורגנים מספר עובדים: 5

תהליך: מיצוי		
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה		
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים		
בקרת תהליך: מנדף		
V	שבועית	די - כלורואתן
V	חודשית	די - כלורואתן (1,1)
V	חודשית	חומצות
		חומצה הידרוכלורית
		חומצה גופרתית
		חומצה אצטית

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	כמות חומר זעירה	MSDS	שם המרכיב	חומר	גורם חשיפה
תהליך: הפרדה כימיה - זיקוק					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
צידוד מגן אישי: מנדף					
בקרת תהליך:					
V	V	שבועית			
מרכיבים בתהליך:					
אתיל אצטט					
אתיל אצטט					
הקסן					
הקסן-נורמלי					
טולואן					
טולואן					
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר- קולונות					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
צידוד מגן אישי: מנדף					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
אתיל אצטט					
אתיל אצטט					
הקסן					
הקסן-נורמלי					
מתנול					
מתנול					
סיליקה					
סיליקה מותכת					
מחלקה: מעבדה לכימיה אי אורגני /קמפוס מרקוס /בניין 62 /חדר 219,220					
מטלה: קומפלקסים, קינטיקות, רדיקלים					
מספר עובדים: 5					
תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר					
שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
צידוד מגן אישי: מנדף					
בקרת תהליך: אוורור כללי					
מרכיבים בתהליך:					
חומצות					
חומצה אצטית					
חומצה גופרתית					
חומצה הידרוכלורית					
מלחים					
V	V	שבועית			
POTASSIUM CHLORIDE					
SODIUM CHLORIDE					
V	יומית				
ניטרוס אוקסיד					
ניטרוס אוקסיד					
תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-GC					
שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
כפפות להגנה מחומרים					
צידוד מגן אישי: אוורור כללי					
בקרת תהליך:					
מרכיבים בתהליך:					
מתנול					
מתנול					

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה לכימיה איאורגני / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדר 204,205	
מטלה: כימיה אי אורגני	
מספר עובדים: 8	

תהליך:		מיצוי
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		חומצה הידרוכלורית
V	V	נדיר
		32.00%
חומצה הידרוכלורית		חומצה הידרוכלורית
חומצה זרחתית		חומצה זרחתית
V	V	נדיר

תהליך:		שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		אזור כללי
מרכיבים בתהליך:		אצטון
V	V	יומית
		אצטון
תערובת חומצות		חומצה הידרוכלורית
חומצה זרחתית		חומצה זרחתית
V	V	יומית

תהליך:		עבודות מחקר ופיתוח-אחר
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		מנדף
מרכיבים בתהליך:		אבץ
V	V	חודשית
		(מתכת)
ברום		ברום
V	V	חודשית
		ברזל
ברזל		ברזל (מתכת)
V	V	חודשית
		כרום
כרום		כרום (מתכת)
V	V	חודשית
		ניקל
ניקל		ניקל (מתכת)
V	V	חודשית
		קדמיום
קדמיום		קדמיום (מתכת ותרבות)

מחלקה: מעבדה לכימיה ביואורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדר 201	
מטלה: תקשורת בין חיידיקים	
מספר עובדים: 9	

תהליך:		שטיפה/ניקוי
איפיון תהליך:		שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:		כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:		אזור כללי
מרכיבים בתהליך:		אצטון
V	יומית	אצטון
		אתיל אצטט
V	יומית	אתיל אצטט

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר		
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: מנדף אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	הקסן	יומית
V	V	V
	הקסן-נורמלי	
מרכיבים בתהליך:	טולואן	יומית
V	V	V
	טולואן	
מרכיבים בתהליך:	כלורופורם	יומית
V	V	V
	כלורופורם	
מרכיבים בתהליך:	סיליקה	יומית
V	V	V
	סיליקה מותכת	

מחלקה: מעבדה לכימיה אורגנית / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדרים 304,305	מטלה: מחקר
מספר עובדים: 8	

תהליך: שטיפה/ניקוי		
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אצטון	יומית
V	V	V
	אצטון	

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר		
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: מנדף	
מרכיבים בתהליך:	אתיל אצטט	שבועית
V	V	V
	אתיל אצטט	
מרכיבים בתהליך:	די - כלורואתן	3-4 פעמים בשבוע
V	V	V
	די - כלורואתן (1,1)	
מרכיבים בתהליך:	סיליקה	שבועית
V	V	V
	סיליקה מותכת	

תהליך: הפרדה כימית		
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: מנדף	
מרכיבים בתהליך:	הקסן	שבועית
V	V	V
	הקסן-נורמלי	
מרכיבים בתהליך:	פנטן	שבועית
V	V	V
	פנטן	

תהליך: בדיקות כימיות-ממוכשרות-GC		
	איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
מרכיבים בתהליך:	חומצות	שבועית
V	V	V
	חומצה גופרתית	3.00%
	חומצה הידרוכלורית	3.00%

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה גידול גבישים / קמפוס מרקוס / בניין 62 / חדרים 101,113	
מטלה: גידול גבישים	מספר עובדים: 5

תהליך: בדיקות פיזיולוגיות- חשמליות					
איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי בנוכחות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים					
בקרת תהליך: מנדף					
V	V	יומית	חומצה הידרוכלורית	מרכיבים בתהליך:	
			חומצה הידרוכלורית		
V	V	יומית	חומצה חנקתית	מרכיבים בתהליך:	
			חומצה חנקתית		

תהליך: שטיפה/ניקוי					
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים					
בקרת תהליך: אוורור כללי					
V	V	חודשית	אצטון	מרכיבים בתהליך:	
			אצטון		
V	V	יומית	מתנול	מרכיבים בתהליך:	
			מתנול		

מחלקה: מעבדה להכנת קטליטורים / קמפוס מרקוס / בניין 63 / חדרים 212-214,224,226,218	
מטלה: מחקר (חדר 212)	מספר עובדים: 2

תהליך: עבודות מחקר ופיתוח-אחר					
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים					
בקרת תהליך: מנדף					
מרכיבים בתהליך: אוורור כללי					
V	V	יומית	אמוניום הידרוקסיד	מרכיבים בתהליך:	
			אמוניה		
V	V	יומית	ברזל	מרכיבים בתהליך:	
			ברזל (תחמוצת ברזל: אבק ונדפים)		
V	V	יומית	ניקל	מרכיבים בתהליך:	
			ניקל (מתכת)		

תהליך: הכנת תערובת					
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך חם					
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים					
בקרת תהליך: מנדף					
V	V	שבועית	הקסן-נורמלי	מרכיבים בתהליך:	
			הקסן-נורמלי		

תהליך: שטיפה/ניקוי					
איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה					
ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים					
בקרת תהליך: אוורור כללי					
V	V	יומית	אצטון	מרכיבים בתהליך:	
			אצטון		

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר	MSDS
כמות חומר זעירה	גורם חשיפה	שם המרכיב
אחוז מרכיב		
מספר עובדים: 2		

מטלה: הפרדה כימית (חדר 218)

תהליך:	הפרדה כימיה - זיקוק	
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך סגור, תהליך חם	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	מנדף	
מרכיבים בתהליך:	סולר	V
	סולר	
		3-4 פעמים בשבוע

תהליך:	עבודות מחקר ופיתוח-אחר	
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	מנדף	
מרכיבים בתהליך:	איזופרופיל אלכוהול	V
	איזופרופיל אלכוהול	V
		3-4 פעמים בשבוע

תהליך:	מיצוי	
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	מנדף	
מרכיבים בתהליך:	פנול	V
	פנול	
		שבועית

מטלה: בדיקות ממוכשרות (חדר 224-226) מספר עובדים: 2

תהליך:	בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC	
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	אזור כללי	
מרכיבים בתהליך:	אצטוניטריל	V
	אצטוניטריל	
		3-4 פעמים בשבוע

תהליך:	בדיקות כימיות-ממוכשרות-GC	
איפיון תהליך:	שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך סגור	
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים	
בקרת תהליך:	אזור כללי	
מרכיבים בתהליך:	חומצות	V
	חומצה הידרופלואורית (כ-פלור)	V
	חומצה גופרתית	
	חומצה הידרוכלורית	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה ננופבריקציות / קמפוס מרקוס / בניין 95 / חדר 101	
מטלה: FAB1	מספר עובדים: 8

	תהליך: הפרדה כימית- נידוף מתכות	
	איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך סגור, תהליך חם	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים מסוכנים עם פילטר	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
V	מתכות שבועית	
	זהב	
	טיטניום (מתכת)	
	פלדיום	
	כרום VI - מסיס	

	המלצה/סיכום: לא מתוכנן ניטור לזהב, טיטניום ופלדיום	
	תהליך: הפרדה כימית- מערכת עיקולים	
	איפיון תהליך: שיטה: אוטומטי ללא שהות העובד לבקרה, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה, תהליך סגור, תהליך חם	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים מסוכנים עם פילטר	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
	ניקה מקומית	
V	H2SO4, SF6 יומית	
	פלאורידים	
	חומצה גופרתית	

	המלצה/סיכום: שימוש בחומרים מתבצע בתהליך סגור	
	מטלה: FAB 2	מספר עובדים: 8

	תהליך: שטיפה/ניקוי	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים מסוכנים	
	בקרת תהליך: אוורור כללי	
V	איזופרופיל אלכוהול יומית	
	איזופרופיל אלכוהול	
V	אצטון יומית	
	אצטון	

	תהליך: בדיקות כימיות ממוכשרות-אחרות- ליטוגרפיה	
	איפיון תהליך: שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה	
	ציוד מגן אישי: כפפות להגנה מחומרים מסוכנים	
	בקרת תהליך: מנדף	
V	אמוניה יומית	
	אמוניה	
V	חומצה גופרתית יומית	
	חומצה גופרתית	
V	חומצה הידרוכלורית יומית	
	חומצה הידרוכלורית	

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה MSDS	גורם חשיפה
שם המרכיב	אחוז מרכיב
מחלקה: מעבדה של אורה קופמן /קמפוס מרקוס /בניין 98 /חדר -120	
מטלה: מחקר	מספר עובדים: 5

תהליך:	הרדמה- הבודה מתבצעת בבית החיות
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	מנדף
מרכיבים בתהליך:	איזופלורן איזופלורן
V	שבועית

מחלקה: מעבדה של אריאל קושמרו /קמפוס מרקוס /בניין 39 /חדר 109	
מטלה: מחקר	מספר עובדים: 2

תהליך:	עבודות מחקר ופיתוח-אחר
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	אתיל אצטט אתיל אצטט
V	שבועית
V	שבועית
V	שבועית
	פוטסיום די-כרומאט כרום VI - מסיס

מחלקה: מעבדה של איתמר פלאי /קמפוס מרקוס /בניין 59 /חדר 329-327	
מטלה: מחקר	מספר עובדים: 5

תהליך:	עבודות מחקר ופיתוח-אחר
איפיון תהליך:	שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה
ציוד מגן אישי:	כפפות להגנה מחומרים
בקרת תהליך:	אוורור כללי
מרכיבים בתהליך:	ניטרוס אוקסיד ניטרוס אוקסיד
V	יומית

מחלקה: בניין 59: הנדסה כימית, חדר 337	
מטלה: מחקר	מספר עובדים: 1

מרכיבים במטלה:	פלסטינות סיבי פחמן
	סיבים מינרליים
	פחמן שחור
תהליך:	עבודות מחקר ופיתוח-אחר
איפיון תהליך:	שיטה: ממוכן בהפעלה צמודה של עובד, משך תהליך: קצר
בקרת תהליך:	מיזוג אוויר אוורור כללי

איפיון של מטלות ותהליכים

תדירות שימוש	חומר
כמות חומר זעירה	MSDS
שם המרכיב	גורם חשיפה
אחוז מרכיב	מחלקה: בניין 62: מעבדה של מאיה בר סדן
מספר עובדים: 4	מטלה: מחקר

	תהליך:
עבודות מחקר ופיתוח-אחר	איפיון תהליך:
שיטה: ממוכן בהפעלה צמודה של עובד, משך תהליך: משמרת חלקית	ציוד מגן אישי:
כפפות להגנה מחומרים	בקרת תהליך:
מנדף	מנדף
אזור כללי	אזור כללי
מיזוג אוויר	מיזוג אוויר
ויסמות, ניקל, קדמיום	מרכיבים בתהליך:
3-4 פעמים בשבוע	קדמיום (מתכת ותרופות)
V	ויסמוט
	ניקל (מתכת)
	טלוא
V	טלואן
3-4 פעמים בשבוע	

החומר הנכלל בסקר הנו כפי שהוצג ע"י נציג הלקוח בפני מבצע הסקר, ביום ביצוע הסקר

טקצ'מן אלכס בוצע על ידי בודק מוסמך:

תכנית ניטור			
מחלקה/מטלה/תהליך	מספר דגימות	גורמים לניטור	סוג תקן:
ביאורגנית/קמפוס מרקוס/בניין 29/חדר 305			
מחקר לכימיה אורגנית / 15 עובדים			
בדיקות כימיות-ממוכשרות-HPLC	3	אצטוניטריל	TWA
מעבדה למיקרואלקטרוניקה ביאורגנית/קמפוס מרקוס/בניין 33/חדר 419			
מיקרואלקטרוניקה ביאורגנית / 3 עובדים			
שטיפה/ניקוי (ניקוי צנטריפוגה)	1	כלורופורם	TWA
מעבדה לנירואימונולוגיה/קמפוס מרקוס/בניין 39			
מחקר נירואימונולוגיה / 10 עובדים			
הרדמה (מכונה)	2	איזופלורן	TWA
מעבדה לנירופיזיולוגיה התנהגותית/קמפוס מרקוס/בניין 40/חדר 316			
נירופיזיולוגיה התנהגותית / 4 עובדים			
יצוב/קיבוע (fixation)	2	פורמאלדהיד	Ceiling
מעבדה לגיאוכימיה אורגנית/קמפוס מרקוס/בניין 58/חדרים 232,234			
גיאוכימיה של נפט, גז וסלעי מקור (חדר 232) / 4 עובדים			
מיצוי	2	טולואן, מתילן כלוריד	TWA
שריפה (מכשיר ROCK EVOL(1300 מאלות))	4	גופרית דו חמצנית, חנקן דו-חמצני, מימן גופרי, פחמן חד-חמצני	TWA
שריפה (מכשיר ROCK EVOL(1300 מאלות))	4	גופרית דו חמצנית, חנקן דו-חמצני, מימן גופרי, פחמן חד-חמצני	STEL
מעבדה של אריאל קושמרו/קמפוס מרקוס/בניין 39/חדר 109			
מחקר / 2 עובדים			
עבודות מחקר ופיתוח-אחר	1	כרום - VI מסיס	TWA
בניין 59: הנדסה כימית, חדר 337			
מחקר /עובד אחד			
עבודות מחקר ופיתוח-אחר	1	פחמן שחור	TWA
בניין 62: מעבדה של מאיה בר סדן			
מחקר / 4 עובדים			
עבודות מחקר ופיתוח-אחר	1	ויסמוט, ניקל (מתכת), קדמיום (מתכת ותרכובות)	TWA
עבודות מחקר ופיתוח-אחר	1	טולואן	TWA

בוצע על ידי בודק מוסמך: **טקצ'מן אלכס**

טופס מהדורה 3